

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-215011
(43)Date of publication of application : 30.07.2003

(51)Int.CI.

G01N 3/56

(21)Application number : 2002-016207
(22)Date of filing : 24.01.2002

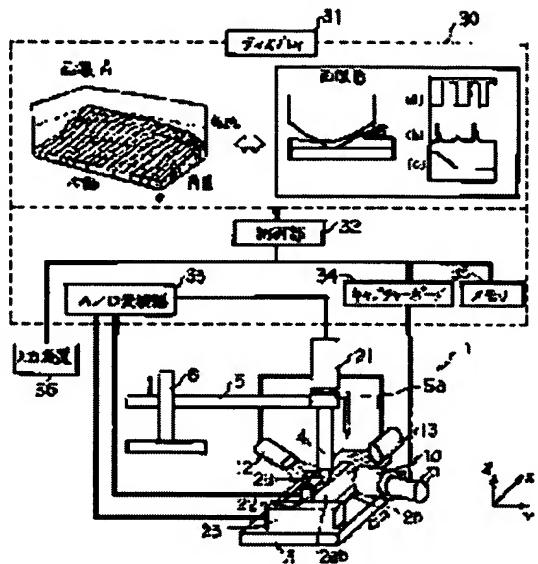
(71)Applicant : AISIN SEIKI CO LTD
(72)Inventor : NIIMI HIROTAKA

(54) CHARACTERISTICS EVALUATING AND TESTING MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a characteristics evaluating and testing machine capable of easily analyzing the characteristics of test pieces.

SOLUTION: A first test piece 2a is fixed to a probe 4, and a base 3 is slid with a second test piece 2b in contact with the first test piece 2a. The images of the contact surfaces of both the test pieces 2a and 2b are picked up by a CCD camera 10 and stored in a memory 35. In addition, the load acting on the probe 4 at sliding is detected by a load sensor 21, the acceleration and state of vibration of the base 3 are detected by an acceleration sensor 22, and the operation resistance of the base 23 is detected by a load cell 23. These items of measurement data are stored in the memory. The measurement data and the image data by the CCD camera 10 both stored in the memory 35 are related to each other and displayed on a display.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 22.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2003-215011

(P 2003-215011 A)

(43) 公開日 平成15年7月30日(2003.7.30)

(51) Int. C l.⁷

G 01 N 3/56

識別記号

F I

G 01 N 3/56

O L

テマコト[®] (参考)

Z

審査請求 未請求 請求項の数 4

O L

(全 5 頁)

(21) 出願番号 特願2002-16207 (P2002-16207)

(71) 出願人 000000011

アイシン精機株式会社

(22) 出願日 平成14年1月24日 (2002.1.24)

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

(72) 発明者 新實 弘崇

愛知県刈谷市昭和町2丁目3番地 アイシン

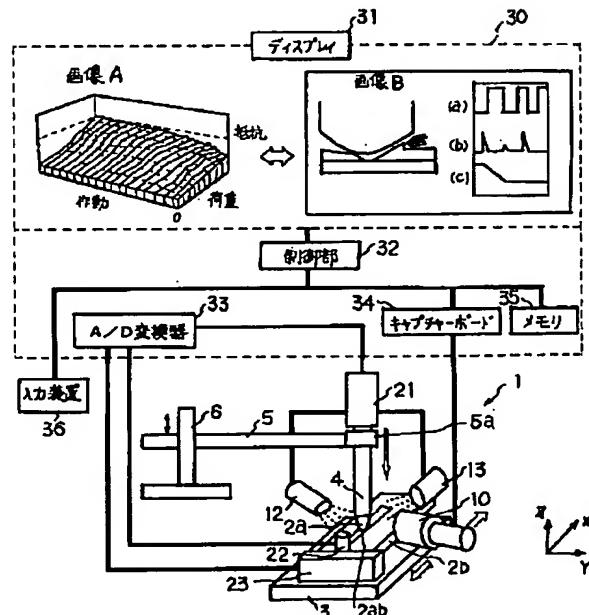
・エンジニアリング株式会社内

(54) 【発明の名称】特性評価試験機

(57) 【要約】

【課題】 試験片の特性解析をし易い特性評価試験機とする。

【解決手段】 第1試験片2aをプローブ4に固定し、第1試験片2aに第2試験片を接触させた状態で基台3を摺動させる。そして、前記両試験片2a, 2bの接触面をCCDカメラ10により撮像してメモリ35に記憶させる。また、摺動時におけるプローブ4に作用する荷重を荷重センサ21により検出し、基台3の加速度や振動状態を加速度センサ22により検出すると共に、基台3の作動抵抗をロードセル23により検出し、これらの計測されたデータもメモリ上に記憶させる。そして、メモリ35に記憶された計測データおよびCCDカメラ10による画像データをディスプレイ上に関連づけて表示させる構成とした。



または回転運動により往復して摺動させることによって、試験片の特性（例えば、抵抗力、変位、振動等）を、固定試験片に対する可動試験片の摺動時の状態（例えば、両試験片が摺動する時の抵抗力、摺動時の振動、接触抵抗等）を、単に測定する。そして、特定時間経過した場合あるいは所定の摺動回数が経過したら、その接触面の摩耗状態を、ビデオカメラにより摩耗進行状態を観察し、摩擦摩耗してゆく過程を解析する方法が取られていた。

10 【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記した解析方法では、摺動中の摩耗進行状態はビデオカメラによって観察できるが、どの様な条件下で両試験片の接触面に摩擦摩耗が発生するかといったことの解析が難しい。つまり、ビデオカメラでとらえた映像と、摺動時に計測されたデータとの結びつけが、困難となり、解析に時間を要するものとなってしまう。

【0005】また、従来では、ビデオカメラから得られた映像を、単に、測定されたデータと照らし合わせるだけで、映像における摩耗粉の発生解析あるいは摺動面の潤滑剤の介入解析など摩擦摩耗を解析するに当たり、十分な解析が行えるようになっていない。

【0006】よって、本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、試験片の特性を解析し易い特性評価試験機を提供することを技術的課題とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記した技術的課題を解決するために講じた技術的手段は、第1試験片が固定される固定部材と、前記第1試験片に第2試験片を接触させた状態で、前記固定部材に対して少なくとも一方向に摺動する基台と、前記両試験片の接触面を撮像する撮像手段と、前記基台上に設けられ、前記基台の動作状態を検出する検出手段と、該検出手段からの情報を基に、摺動により得られる前記両試験片の特性における物理量を監視する監視手段とを備えた特性評価試験機において、

前記撮像手段から得られる情報と前記検出手段から検出される物理量を同期させて状態メモリに記憶させ、該状態メモリに記憶させた前記情報と前記物理量とを関連させて表示手段に表示を行う特性解析手段を備えたことを特徴とする特性評価試験機。
【請求項2】 前記特性解析手段は、摺動により得られる物理量の特定位置を指示すると、該特定位置での前記撮像手段により撮像された情報が前記表示手段に表示されることを特徴とする請求項1に記載の特性評価試験機。
【請求項3】 前記両試験片の接触部位に対して光を照射する照射手段を、更に備えたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の特性評価試験機。
【請求項4】 前記検出手段は、前記基台または前記接触部位の温度、前記基台の摺動時の変位、前記基台の作動抵抗力、前記接触部位の電気抵抗のいずれかを検出することを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の特性評価試験機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、試験片の特性評価を行う特性評価試験機に関するものであり、特に、2つの試験片を接触させた状態で摺動させることによって、試験片の経時的な特性解析を行う特性評価試験機に係わる。

【0002】

【従来の技術】この主の特性評価試験機の中の一つに、摩擦試験機が知られている。摩擦試験機は、固定試験片を荷重をかけた状態で、可動試験片に接触させる。そして、可動試験片に固定試験片が接触した状態で、モータの動力により固定試験片に対して可動試験片を摺動させて、その摺動による両試験片の接触面での摩耗状態を、顕微鏡レンズ付小型ビデオカメラで撮像する。そして、小型ビデオカメラの映像信号を記録し、可動試験片の回転に同期して可動試験片の一定点の映像を順次記憶および上映できるようにした摩擦試験機が、例えば、特開平5-133867号公報に開示されている。

【0003】この様な摩擦試験機においては、摩擦摩耗特性を評価するに当たり、可変または一定荷重の力を一方の試験片に付与し、他方の試験片を連続的に直線運動

30 せた状態で、前記固定部材に対して少なくとも一方向に摺動する基台と、前記両試験片の接触面を撮像する撮像手段と、前記基台上に設けられ、前記基台の動作状態を検出する検出手段と、該検出手段からの情報を基に、摺動により得られる前記両試験片の特性における物理量を監視する監視手段とを備えた特性評価試験機において、前記撮像手段から得られる情報と前記検出手段から検出される物理量を同期させて状態メモリに記憶させ、該状態メモリに記憶させた前記情報および前記物理量とを関連させて表示を行う特性解析手段を備えたことである。

40 【0008】上記した手段によれば、特性解析手段は撮像手段から得られる接触面の情報と検出手段から検出される物理量を同期させて状態メモリに記憶させる。そして、この状態メモリに記憶させた情報および物理量とを関連させて表示手段に表示を行うので、特性解析手段は状態メモリから記憶された情報を引き出して、撮像手段から得られる情報と検出手段により検出された物理量とを関連づけて表示手段に表示することによって、特定状態での解析が従来に比べて容易となる。尚、この解析を行うに当たり、第1試験片と第2試験片は、互いに特性が同一あるいは異なっていても良い。

【0009】この場合、特性解析手段は、摺動により得られる物理量の特定位置を指示すると、特定位置での撮像手段により撮像された情報が表示されるようすれば、単に特定位置を指示するだけで、状態メモリに記憶された情報が関連づけて表示されるので、どの様な状態下で、試験片の特性が急激に変化するのかといった解析がし易くなる。

【0010】また、両試験片の接触部位に対して光を照射する照射手段を更に備えれば、撮像手段による両試験片の接触面が明るくなり、接触面の状態が確実に撮像される。

【0011】更に、検出手段は、基台または接触部位の温度、基台の摺動時の変位、基台の作動抵抗力、接触部位の電気抵抗のいずれかを検出するようすれば、これらの特性を元にした詳細な特性解析（例えば、何が原因で、特性が変化するのかといった解析）が行える。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。

【0013】図1は、特性評価試験機の構成を示すシステム構成図である。第1実施形態においては、特性評価試験機1を摩擦摩耗試験機（単に、試験機と称す）に適用した場合について、以下に説明を行うが、これに限定されるものではなく、本発明は試験片の経時的な特性解析を行う試験機に適用が可能である。

【0014】(第1実施形態)図1に第1実施形態における試験機1の構成を示す。第1実施形態に示す試験機1は、特性の同一または異なる2つの試験片2（2a, 2bとする）を互いに接触させた状態で、両者を摺動させて、接触面2abでの摩擦摩耗が発生する状態を、監視あるいは解析する装置である。試験機1は一方の試験片（例えば、摺動を行っても特性が変化しない材質であるダイヤモンドまたはサファイア等を使用）2aを、棒状の固定部材（プローブを使用）4に固定させる。この場合、試験片2aの固定は、摺動時に外れない様にチャックによる把持、ボルトによる固定、接着による固定等の固定方法により、プローブ4に取り付けられる。プローブ4は、棒状のアーム5を介して固定され、アーム5は荷重可変装置6により一方が支持される。

【0015】荷重可変装置6はアーム5を、図1に示すz方向に上下動させる装置であり、その結果、アーム5に固定されるプローブ4を上下動させるよう機能する。アーム5は、荷重可変装置6が上昇動作する場合に上昇するが、荷重可変装置6が下降動作する場合には、下降するようになっている。アーム5においてプローブ4が固定される固定部位5aの近傍位置には、アーム5に作用する力（抵抗力等）を検出するために、歪ゲージ等に代表される荷重センサ21が取り付けられている。荷重センサ21はアーム5に作用する変位を検出できれば良く、歪ゲージの他に、光変位計、ポテンショメータ、磁

場変位計であっても良い。

【0016】一方、試験機1には、長方形を呈し、少なくとも一方向（x方向）に往復動作を行う基台3を備えている。この基台3には、もう一方の試験片（例えば、摩擦摩耗の状態を解析する導電部材、メッキ部材等）2bが動かない様に試験片2bが基台3に対して、位置決めピンあるいはボルト等により固定される。試験片2bが固定された基台3は、x方向に往復動作を行う。この場合、プローブ4に固定された試験片2aの先がもう一方の試験片2bに接触した状態で荷重可変装置6によりx方向への往復において徐々に接触面2abの面圧を増加させ、復動において徐々に接触面2abの面圧を現象させるようにして、試験が行われるようになっている。

【0017】また、基台3には、試験片2b（つまり、接触面2ab）に作用する抵抗力を検出できる様、ロードセル23が備え付けられている。また、基台3の摺動時におけるz方向やy方向の振動、あるいは、基台3を摺動時の加速度が検出される様、一軸あるいは多軸の加速度を検出する加速度センサ22が、基台3に取り付けられている。

【0018】更に、試験機1には両試験片2（2a, 2b）の摺動時における接触面2abの状態を観察あるいは解析するため、CCDカメラ10が接触面2abの近傍の固定部材（図示せず）に設けられ、接触面2abの状態を、CCD素子によって撮像することができる。尚、本実施形態では両試験片2の接触面2abを固定されたCCDカメラ10により撮像するようしているが、これに限定されるものではなく、任意に撮像方向の向きを操作可能なCCDカメラや、操作型光学顕微鏡等であっても良い。また、試験機1にはCCDカメラ10による撮像の明度を上げるために、接触面2abに対して、照明を行う光源（例えば、ハロゲン光、クリップトン光等）12, 13が、図示しない固定部材に設けられている。この光源12, 13によって、接触面2abは明るく照らされる。尚、本実施形態では、光源12, 13は互いにプローブ4に対して反対側に配設され、接触面2abを照らすことが可能である。光源12, 13の配置あるいは取り付け位置は、これに限定されるものではなく、光源12, 13は独立駆動され、照射方向を変えるものであっても良い。また、CCDカメラ10が向けられた方向に光源12, 13の照射方向が向く構成を取っても良い。

【0019】以上、説明した様に、上記した構成の試験機1は、制御部32により基台3を摺動させ、荷重可変装置6を駆動させることによりアーム5をz方向に上限動させ、接触面2aでの荷重を可変することができる。更にこの構成において、制御装置32は、基台3を摺動動作させる場合、試験機1に取り付けられた荷重センサ5aからの荷重信号、加速度センサ23からの基台3の

加速度あるいは摺動時における基台3の振動といった信号、ロードセル23から作動抵抗に関する信号を同時に時系列的に入力し、入力されたこれら信号をメモリ35に記憶する。一方、制御部32はCCDカメラ10のCCD素子によりとらえた接触面2abの映像信号をビデオキャプチャーボード34に入力し、ビデオキャプチャーボード34にてアナログのビデオ信号はデジタル変換されて画像データとなる。その画像データがメモリ35に時系列的に記憶され、ディスプレイ31の画面に表示される構成となっている。

【0020】制御部32は、各種センサからの信号（ロードセル23、加速度センサ22、荷重センサ21等）の内、少なくともいすれかの信号に同期させて画像データをメモリ35に記憶する同期回路を内部に備える。また、制御部32には、キーボード、タブレット入力形式の入力ペン、マウス等のいすれかである入力装置36が電気的に接続されており、この入力装置36の操作によって、ディスプレイ31への表示形態を任意に変えることが可能な構成となっている。

【0021】この入力装置36によりディスプレイ上への表示形態が指示されると、必要に応じてメモリ35に記憶されたデータは、マルチ画面表示可能なディスプレイ31に、CCDカメラ10により撮像した接触面2abの画像データ、あるいは、入力装置36の指示により特定されたセンサの基台摺動時における波形が、それあるいはマルチ画面で関連づけられた状態で表示される（例えば、図1に示す画像A（単独表示）あるいは画像B（複合表示）の様な表示形態）。

【0022】この様な構成により、各種センサからの情報（計測データ）やCCDカメラ10から得られる画像データが、互いに同期してメモリ35に一旦記憶され、メモリ35に記憶されたデータがディスプレイ上に関連づけて表示されるので、容易に接触面2abでの摩擦摩耗の瞬間の画像データと各種センサから得られたデータを一致させてディスプレイ上に表示させることができるので、摩擦摩耗試験の解析を行う解析技術が飛躍的に向上する。

【0023】この場合、接触面2abをCCDカメラ10により2次元的にトラッキング追跡して、ディスプレイ上にその軌跡表示や、基台3の移動速度あるいは加速度等を計測し、メモリ35にデータ記憶させ、記憶させたデータを基にしてのデータの解析が容易に行える。また、動画像であるポイントを追跡し、ディスプレイ上に、その移動ベクトルを表示させたり、ベクトルの速度や向きを表示させて、解析を行うことが可能となる。

【0024】（第2実施形態）図2に、第2実施形態の構成の概要を示す。この第2実施形態では、基板に形成された導電性の回路パターン44上にグリースが塗布され、その上をブラシ41が摺動する場合におけるブラシ41の接触点での特性変化（特に、電圧降下）を検出す

るものである。この構成では、回路パターン44上にブラシ41が接触しており、ブラシ41は抵抗（例えば、1.5KΩ）42を介して接続される。そして、抵抗42の一端と回路パターン44との間を定電圧電源50によって、所定電圧が印加されるようとする。そして、ブラシ41の接触点での電圧降下を電圧計43により測定し、接触点における摩擦摩耗の状態を解析できるようになっている。具体的には、図1に示す第1実施形態において、図2に示す構成を適用した。つまり、第1試験片

10 2aとしてブラシ41をプローブ4固定する。一方、摺動動作する基台3側には試験片2bとして導体の配線パターン44が表面に形成された回路基板を基台3に固定し、図2の如く、ブラシ41には抵抗42を介して所定電圧50を印加する。そして、ブラシ41の接触点における摩擦摩耗に起因する電圧降下の様子を電圧計42からの情報を測定データとしてメモリ35に記憶せると同時に、CCDカメラから撮像した画像データとをメモリ35に同期させて関連づけて記憶させ、その記憶されたデータを基にして、時系列的に接触点の摩擦摩耗状態を解析することが可能である。

【0025】例えば、複数のセンサにより測定されたデータを多軸で表示（例えば、図1の画面Aに示す表示）させ、その任意の位置を入力装置36により指示すると、その状態での画像データがディスプレイ上に、図3に示す模式図の如く状態がわかり易く制御部32において解析処理された上で表示されるので、従来に比べて解析に要する工数が大幅に低減できる。

【0026】上記の構成により、ブラシ41の接触点における接触不良解析が行え、ブラシ41の回路パターン44に対する接触状態（例えば、図3の(a)～(c)の様な接点摩耗、ブラシ41の接触面への異物の混入状態、グリースの介入状態等）が画像データと関連づけて、接触抵抗増大のメカニズム解析が行える。

【0027】また、これとは別に、コーティング開発において、コーティング組成の違いによる摩耗状態（例えば、アブレッシュブル摩耗、マイルド摩耗等）とその現象（操作力(μ)、摩耗、振動）が画像データと関連づけて、組成の違いによる摩耗形態、使用限界が明確になり、材料開発が促進される。

40 【0028】更に、グリースの選定においては、グリース組成の違いによる接触部状態（アブレッシュブル摩耗、マイルド摩耗、接触部への油分介入状況の違い等）と現象（操作力(μ)、摩耗、振動）が画像データと関連づけて、組成の違いによる摩耗形態、使用限界などの差が明瞭になり、材料開発が促進される。

【0029】

【発明の効果】本発明によれば、特性解析手段は撮像手段から得られる接触面の情報と検出手段から検出される物理量を同期させて状態メモリに記憶させ、状態メモリに記憶させた情報および物理量とを関連させて表示を行

うので、摺動を行う評価試験の後でも、特性解析手段の状態メモリから記憶された情報を引き出して、撮像手段から得られる情報と検出手段により検出された物理量とを関連づけて表示手段に表示することによって、特定状態での解析が従来に比べて容易にできる。

【0030】この場合、特性解析手段は、摺動により得られる物理量の特定位置を指示すると、特定位置での撮像手段により撮像された情報が表示されるようすれば、単に特定位置を指示するだけで、状態メモリに記憶された情報が関連づけて表示されるので、どの様な状態下で、試験片の特性が急激に変化するのかといった解析が容易にできる。

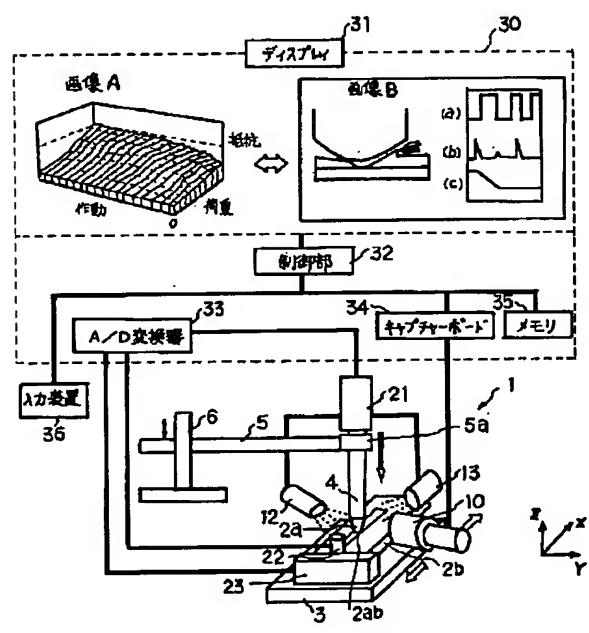
【0031】また、両試験片の接触部位に対して光を照射する照射手段を更に備えれば、撮像手段による両試験片の接触面が明るくなり、状態を確実に撮像でき、特性評価試験機の信頼性が向上する。

【0032】更に、検出手段は、基台または接触部位の温度、基台の摺動時の変位、基台の作動抵抗力、接触部位の電気抵抗のいずれかを検出するようになれば、これらの特性を元にした詳細な特性解析（例えば、何が原因で、特性が変化するのかといった解析）が容易にできる。

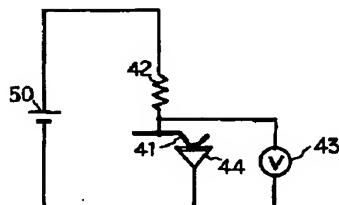
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態における特性評価試験機

【四】



【図2】



〔四三〕

